

課題番号 : F-13-FA-0001
利用形態 : 機器利用
利用課題名 (日本語) : 光エネルギー変換デバイスの開発
Program Title (English) : Development Opto electronic devices
利用者名 (日本語) : 久保 敏
Username (English) : S.KUBO
所属名 (日本語) : (有)FTC コーポレーション
Affiliation (English) : FTC CORPORATION.

1. 概要 (Summary)

サファイア、ガラス、Si 基板上に高効率素子の製作
耐候膜の開発製造
高効率基板の開発、製造

2. 実験 (Experimental)

薄膜形成
PE-CVD、LP-CVD、酸化炉
パターン形成
コータデベロッパー、露光機、RIE 他



Plasma CVD Low Pressure CVD



Thermal Furnace Reactive Ion Etcher

3. 結果と考察 (Results and Discussion)

様々な形状作成し効率評価実施。
膜については光の透過率、エネルギーロス低減に向けたサンプル製作評価中。

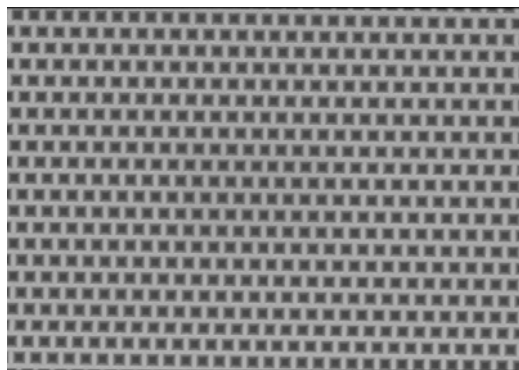
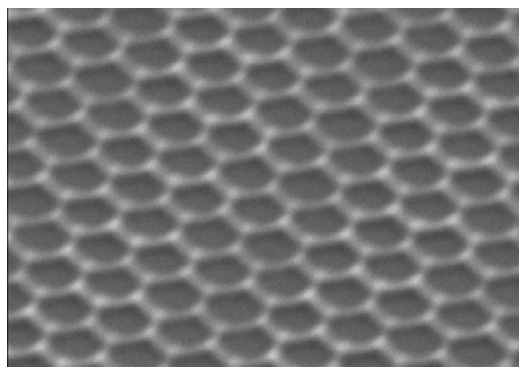


Fig1. High-efficient-Substrate

4. その他・特記事項 (Others)

なし。

5. 論文・学会発表 (Publication/Presentation)

なし。

6. 関連特許 (Patent)

なし。